

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 3332463 A1

⑤ Int. Cl. 3:
G01 S 3/78

⑳ Aktenzeichen: P 33 32 463.8
㉑ Anmeldetag: 8. 9. 83
㉒ Offenlegungstag: 3. 5. 84

③① Unionspriorität: ③② ③③ ③④
29.10.82 US 437721

⑦① Anmelder:

The Perkin-Elmer Corp., 06856 Norwalk, Conn., US

⑦④ Vertreter:

Grünecker, A., Dipl.-Ing.; Kinkeldey, H., Dipl.-Ing.
Dr.-Ing.; Stockmair, W., Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Ae.E. Cal
Tech; Schumann, K., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat.; Jakob,
P., Dipl.-Ing.; Bezold, G., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.;
Meister, W., Dipl.-Ing.; Hilgers, H., Dipl.-Ing.;
Meyer-Plath, H., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 8000
München

⑦② Erfinder:

Grotts, Jeffrey W., 06801 Bethel, Conn., US; Abreu,
Rene, 06810 New Fairfield, Conn., US

⑤④ Nichtabbildendes System zur Feststellung des Einfallswinkels einer Strahlung

Es wird ein nichtabbildender Detektor für die direkte Mes-
sung des Einfallswinkels der Strahlung in einer Ebene von
einer Strahlungs- insbesondere einer Lichtquelle, beschrie-
ben. Der Detektor enthält eine Schlitzmaske, die schmale
Strahlungslinien auf eine Gruppe von Detektorelementen
durchläßt, die sich direkt unter der Schlitzmaske befinden.
Die Detektoren haben eine solche Form, daß sie lichtelektri-
sche Photoströme erzeugen, deren Verhältnis exponentiell
zunimmt, wenn sich die Strahlungslinien durch die Schlitz-
e in Abhängigkeit von Änderungen im Einfallswinkel längs der
Gruppe verschieben. Die Formen der Detektoren werden
entsprechend einer exponentiellen Gleichung ausgelegt, so
daß die benachbarten Reihen von Detektoren Photoströme
mit entsprechenden Größen erzeugen; dadurch führt die
Differenz der Logarithmen der Photoströme von benachbar-
ten Reihen zu einem Signal, das direkt proportional zu dem
Einfallswinkel ist, wenn durch entsprechende Schaltungen
eine solche Subtraktion durchgeführt wird.

DE 3332463 A1

3332463

GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & PARTNER

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

A GRÜNECKER, DR. ING.
DR. H. KINKELDEY, DR. ING.
DR. W. STOCKMAIR, DR. ING. u. P. KALTEFLUT
DR. K. SCHUMANN, DR. PHYS.
P. H. JAKOB, DR. ING.
DR. G. BEZOLD, DR. CHEM.
W. MEISTER, DR. ING.
H. HILGERS, DR. ING.
DR. H. MEYER-HATH, DR. ING.

8000 MÜNCHEN 22
MAXIMILIANSTRASSE 59

P H 18 073

THE PERKIN-ELMER CORPORATION

Main Avenue

Norwalk, Connecticut 06856

U S A

Nichtabbildendes System zur Feststellung
des Einfallswinkels einer Strahlung

Patentansprüche

1. Detektor zur Bestimmung des Einfallswinkels einer Strahlungsquelle in einer senkrecht zu dem Detektor verlaufenden Ebene, gekennzeichnet durch eine lichtundurchlässige, planare Schlitzmaske (32) mit wenigstens einem schmalen, transparenten, geradlinigen Schlitz (34, 35, 36) in der lichtundurchlässigen Ebene der Schlitzmaske (32), und durch eine Detektorgruppe (10), die in einer Ebene parallel zu dem Abstand von der planaren Schlitzmaske (32) angeordnet ist und mehrere, benachbarte, identische Detektorelemente (22, 23, 24), deren Längsachsen jeweils parallel zueinander und senkrecht zu dem transparenten Schlitz (34, 35, 36) sind, weiterhin

2. Detektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektorgruppe (10) mehrere benachbarte Streifen (12-20) aufweist, daß jeder Streifen (12-20) mehrere Detektorelemente (22, 23, 24) bildet, daß die Elemente (22, 23, 24) in jedem Streifen (12-20) in Reihe mit einem der zweiten Leiter geschaltet sind, und daß die Musterform der Detektorelemente in jedem der Streifen im Vergleich mit der Musterform der Elemente in den benachbarten Streifen umgekehrt ist.

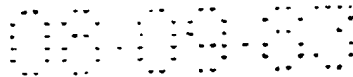
3. Detektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Musterform jedes Detektorelementes das logarithmische Glied enthält, und daß die Längsbewegung eines dünnen, in Querrichtung verlaufenden Lichtstrahls über das Element durch den ersten und zweiten Leiter lichtelektrische Photo-

- 1 ströme mit einem exponentiellen Amplitudenverhältnis erzeugt.
- 5 4. Detektor nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Streifen (12-20) von Detektorelementen auf einem Detektormaterial mit einer daran befestigten, darüber liegenden, lichtundurchlässigen Maske (21) mit einem Muster ausgebildet ist, das jedes Detektorelement freigibt, und daß der zweite Leiter längs der oberen, in Längsrichtung verlaufenden Mitte jedes Elementes liegt.
- 10 5. Detektor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß jedes der Elemente, das durch die darüber liegende Maske (21) freigegeben wird, erste und zweite, miteinander verbundene Detektorabschnitte enthält, die jeweils die Hälfte der Länge jedes Elementes einnehmen, wobei der erste Abschnitt über seine gesamte Länge eine konstante Breite hat, während der zweite Abschnitt an seinem ersten Ende eine Breite hat, die der Breite des damit verbundenen, ersten Abschnittes entspricht, und sich diese Breite entsprechend einer Exponentialkurve von diesem Punkt zum zweiten Ende dieses Abschnittes hin verringert.
- 20 6. Detektor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Breite des zweiten Abschnittes jedes Detektorelementes von dem ersten Ende zum zweiten Ende des Abschnittes hin entsprechend einer Kurve nach der folgenden Gleichung verringert:
- 25 30

$$f(x) = e^{(K \sin^{-1} \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + H^2}})}$$

35 wobei bedeuten:

n_1 = Brechungsindex der darüber



3332463

- 4 -

1
liegende Maske (21)
n2 = Brechungsindex von Luft
X = in Längsrichtung ein Punkt,
5 gemessen von dem ersten Ende
des zweiten Abschnittes aus, und
H = der Abstand zwischen der Ober-
fläche des Detektorelementes und
der lichtundurchlässigen, plana-
ren Schlitzmaske (32).
10

7. Detektor nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mit dem Leiter in abwechselnden Streifen
von Detektorelementen eine erste Leitung gekoppelt ist,
15 daß mit den übrigen Streifen von Detektorelementen eine
zweite Leitung gekoppelt ist, daß erste und zweite loga-
rithmische Schaltungen vorgesehen sind, die jeweils mit
den ersten und zweiten Leitungen gekoppelt sind, um erste
und zweite Ausgangssignale zu erzeugen, die proportional
20 zu dem natürlichen Logarithmus der lichtelektrischen Photo-
ströme in der ersten bzw. zweiten Leitung sind, und daß
mit den ersten und zweiten logarithmischen Schaltungen Dif-
ferenzglieder gekoppelt sind, um die ersten und zweiten
Ausgangssignale zu subtrahieren und ein Ausgangssignal zu
25 erzeugen, welches direkt proportional zu dem Einfallswin-
kel der Strahlung in einer senkrecht zu dem Detektor ver-
laufenden Ebene ist.

30

35


5

1
Nichtabbildendes System zur Feststellung
des Einfallswinkels einer Strahlung

5
Beschreibung

Die Erfindung betrifft allgemein einen Strahlungsdetektor,
und insbesondere einen nichtabbildenden Detektor für die
direkte Messung des Einfallswinkels der von einer Strah-
10 lungsquelle kommenden Strahlung aus einer Ebene senkrecht
zum Detektor.

Dieser Detektor und seine relativ einfache, zugehörige
elektrische Schaltung erzeugt ein Ausgangssignal mit einer
15 Amplitude, die proportional zu dem Winkel ist, in dem eine
Strahlungsquelle, wie beispielsweise die Landungslampen
eines Flugzeugs oder das periodisch aufblitzende Licht
eines entfernten Flugzeugs, von einer Ebene verschoben
ist, die senkrecht zur Oberfläche des Detektors verläuft.
20 Beispielsweise kann der Detektor so angeordnet und aus-
gerichtet werden, daß er einen Azimut-Winkel von einem
bestimmten Bezugspunkt feststellt, wie beispielsweise vom
Kopfpunkt der Rollbahn eines Flughafens; wenn ein solcher
Detektor dann der Strahlung vom Landungslicht eines Flug-
25 zeuges ausgesetzt wird, erzeugt er ein Ausgangssignal, das
proportional zu dem Azimut-Winkel des Flugzeugs, gemessen
vom Kopfpunkt der Rollbahn aus, ist. Wenn die Messung des
horizontalen Annäherungswinkels erforderlich ist, muß ein
zweites Detektorsystem verwendet werden, welches entspre-
30 chend ausgerichtet ist, um die Flugbahn oder den Höhenwin-
kel festzustellen. Die Detektoren sind so ausgelegt, daß
sie gegenüber Änderungen der Strahlung in der senkrechten
Achse vollständig unempfindlich sind, so daß es keine
Kreuzstörungen zwischen Detektoren gibt, die in zueinander
35 senkrechten Ebenen arbeiten.

- 1 Der noch zu beschreibende Detektor ist unempfindlich gegen-
über kurzen Strahlungsausbrüchen oder Änderungen der Strah-
lungsintensität und liefert kontinuierlich exakte, sich
5 nicht ändernde Ausgangssignale für die Winkelanzeige, so-
lange das sich nähernde Flugzeug manövriert und erfaßt
werden kann und der Lichtstrahl auf den Detektor zu und
von ihm weg geschwenkt wird. Deshalb können also zwei oder
mehr Detektoren mit ihren zugehörigen elektrischen Schal-
10 tungen in einem (automatischen) Nachtlandesystem oder für
andere Anwendungsfälle verwendet werden, bei denen exakte
Angaben über die Richtung einer Lichtquelle erforderlich
sind.
- 15 Der Detektor und die zugehörigen Schaltungen können bei
Bedarf extrem klein ausgelegt und in Massenfertigung zu
relativ geringen Kosten durch herkömmliche Ablagerungs-
techniken hergestellt werden, wie sie auch bei der Ferti-
gung von integrierten elektronischen Schaltungen eingesetzt
20 werden. Die Detektorgruppe besteht aus einer relativ gro-
ßen Zahl von dünnen, benachbarten, parallelen Streifen aus
einem Detektormaterial mit geeigneter Empfindlichkeit
für die festzustellende Strahlung. Über jedem parallelen
Streifen befindet sich eine Maske, die so abgelagert wor-
25 den ist, daß sie offene Flächen frei läßt; diese Flächen
enthalten dann mehrere, identische, in Reihe geschaltete
Detektorelemente mit bestimmter Form auf der Oberfläche
des Detektormaterials. In Längsrichtung durch jeden Reihen-
detektor in einem Detektorstreifen verläuft ein abgelager-
30 ter, elektrischer Leiter, um das Photodetektorsignal zu
der zugehörigen, externen Schaltung zu übermitteln. Das
Maskenmuster ist in jedem benachbarten Streifen umgekehrt;
die elektrischen Leiter, die ^{mit} den Detektoren jedes dieser
abwechselnden Streifen der Gruppe verbunden sind, sind
35 miteinander gekoppelt, so daß in abwechselnden Streifen
die lichtelektrischen Photoströme in den Leitern in entge-

1

gengesetzten Richtungen fließen.

- 5 Im geringen Abstand über der Gruppe von Detektoren, jedoch
im Abstand davon, ist eine obere, lichtundurchlässige
Schlitzmaske mit mehreren, schmalen, parallelen Schlitzen
oder transparenten Linien angeordnet, die seitlich zur
Längsachse jedes parallelen Detektorstreifens ausgerichtet
10 sind. Der gleiche Abstand zwischen jedem Schlitz in dieser
Vielzahl von Schlitzen entspricht der Länge jedes Detektor-
elementes in jedem parallelen Streifen; die Mittellinie
jedes Schlitzes ist exakt über und parallel zu einer seit-
lichen Linie über die Mitte jedes Elementes angeordnet. Da-
mit wird also die Strahlung von der Quelle exakt senkrecht
15 zur Oberfläche der oberen Schlitzmaske als schmale Strah-
lungsschlitze über die Detektorgruppe projiziert, wobei je-
de Projektionslinie die Mitte der Detektoren in benachbar-
ten, parallelen Streifen kreuzt.
- 20 Wie oben angedeutet wurde, haben die in Reihe geschalteten
Detektoren in benachbarten, parallelen Streifen umgekehrte
Maskenmuster, so daß ihre jeweiligen Ausgangsströme ent-
sprechend den Musterrichtungen fließen. Wenn die projizier-
te Strahlung durch die Schlitze der oberen Schlitzmaske
25 auf die Mitten der Detektoren in benachbarten Gruppen
fällt, wird jeder Detektor in gleicher Weise erregt, d.h.,
die lichtelektrischen Photoströme von benachbarten Streifen
sind gleich, so daß ihre Differenz zu Null wird. Die Masken
in abwechselnden Detektorstreifen haben jedoch eine solche
30 Form, daß sich fortschreitend eine geringe Strahlung und
damit geringere Photoströme ergeben, wenn sich die Strahlung
durch die obere Schlitzmaske in Längsrichtung von der Mitte
der Detektorzellen zu den Enden hin verschiebt. Deshalb er-
zeugen bei einer Änderung des Winkels der Strahlungsquelle
35 die Detektoren in einem abwechselnden Streifen geringere
Ströme, während die anderen, abwechselnden Streifen von De-

1 tektoren weiter die gleichen Ströme oder in Abhängigkeit
von der Auslegung der Detektormaske größere Ströme erzeugen. Damit nimmt also bei einer Änderung des Strahlungswinkels die Differenz der lichtelektrischen Photoströme von
5 den Detektoren in abwechselnden Streifen zu. Man könnte annehmen, daß es eine leichte Aufgabe wäre, den Winkel der Strahlungsquelle durch Messung der Gesamtströme von den abwechselnden Streifen in der Gruppe zu bestimmen, d.h., die
10 entsprechenden Arbeitsgänge durchzuführen. Unglücklicherweise sind jedoch die Probleme, die mit der Durchführung dieser Teilung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der gewünschten Empfindlichkeit und des dynamischen Bereiches verbunden sind, beträchtlich und nur mit hohem Kostenaufwand zu lösen; außerdem führen sie oft zu Fehlern, die
15 diese Lösung für die Praxis ungeeignet machen.

Im einzelnen enthält die Detektorgruppe nach der vorliegenden Erfindung mehrere, langgestreckte, benachbarte Detektorstreifen, wobei jeder Streifen auf seiner Oberfläche mit einer Maske versehen ist, um nur mehrere, identische, in Reihe geschaltete Detektorelemente freizugeben; ein
20 Leiter für den Photostrom ist in Längsrichtung auf der Oberfläche der Elemente in jedem Streifen ausgerichtet. Die Elemente auf abwechselnden Detektorstreifen sind im
25 Vergleich mit denen der benachbarten Streifen in entgegengesetzter Richtung ausgerichtet, so daß von jeder Gruppe von abwechselnden Detektorstreifen lichtelektrische Photoströme erhalten werden können, die jeweils in entgegengesetzten Richtungen fließen. Die gesamte Detektorgruppe befindet sich unter und im Abstand von einer parallelen,
30 lichtundurchlässigen Maske in einer Ebene mit schmalen, transparenten Schlitten, die senkrecht zu einer Längsachse der Detektorstreifen verlaufen und in einem Abstand voneinander angeordnet sind, der gleich der Länge jedes Detektorelementes in den Streifen ist. Die Strahlung von einer
35

- 1 Strahlungsquelle, die auf die Maskenebene von einer senkrecht zu der Ebene des Detektors verlaufenden Quelle trifft, passiert die schmalen Querschlitzte der Strahlung über den
- 5 Detektorstreifen und über der Mitte jedes Elementes. Wenn der Einfallswinkel von dieser Senkrechten abweicht, verschieben sich die Querstrahlungsschlitzte in Längsrichtung über die Elemente. Die Form jeder Maske, die über den Detektorstreifen liegt und mehrere, identische Elemente bildet, entspricht einer bestimmten exponentiellen (Streu-
- 10 licht)Blendenfunktion, welche die direkte Ableitung des Einfallswinkels ermöglicht, indem der Logarithmus der beiden lichtelektrischen Photoströme von jeder Gruppe von abwechselnden Detektoren subtrahiert wird; diese Berechnung
- 15 läßt sich mit im Handel erhältlichen, integrierten Schaltungen leicht ausführen, ohne daß Einbußen an Empfindlichkeit, Genauigkeit oder Zuverlässigkeit in Kauf genommen werden müssen.
- 20 Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden, schematischen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen
- 25 Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer Detektorgruppe mit der darüber liegenden Schlitzmaske und der elektronischen Schaltung, und
- Fig. 2 im stark vergrößerten Maßstab eine perspektivische Ansicht eines Detektorelementes der Gruppe
- 30 nach Fig. 1.
- Fig. 1 zeigt einen Abschnitt einer Detektorgruppe 10, die mehrere, benachbarte, parallele Streifen 12 bis 20 aufweist; jeder Streifen ist aus einem zweckmäßigen Detektormaterial
- 35 hergestellt, das empfindlich für den Wellenlängenbereich des festzustellenden Lichtes ist. Jeder parallele Streifen

1 ist mit einer daran befestigten, darüber liegenden, licht-
undurchlässigen Maske 21 beschichtet, die mehrere, in
Reihe geschaltete, diskrete Detektorelemente freigibt, wie
5 beispielsweise die Elemente 22, 23 und 24 auf dem Detek-
torstreifen 12. Die unteren Oberflächen aller Detektor-
streifen sind mit einem gemeinsamen Leiter 25 gekoppelt;
jeder Streifen 12 bis 20 enthält einen oberen, elektri-
schen Leiter 26, der sich in Kontakt mit der oberen Ober-
10 fläche jedes Elementes in dem Streifen befindet, um den
lichtelektrischen Strom von jedem der reihengeschalteten
Elemente in jedem Streifen abzuleiten.

Wie man in Fig. 1 erkennt, sind die Reihenelementen in be-
nachbarten Detektorstreifen, wie beispielsweise die Strei-
15 fen 12 und 14 oder 14 und 16, in Musterrichtung umgekehrt
angeordnet, wobei die Leiter für den lichtelektrischen
Strom der abwechselnden Streifen miteinander verbunden
sind. D.h. also, daß die Leiter von abwechselnden Detek-
20 torstreifen 12, 16 und 20 mit einer gemeinsamen Leitung
28 und die Leiter von den abwechselnden Streifen 14 und 18
mit dem gemeinsamen Leiter 30 verbunden sind.

Über der Detektorgruppe 10 und parallel dazu ist eine
25 Schlitzmaske 32 angeordnet, die aus einem lichtundurchläs-
sigen Material mit mehreren, transparenten, parallelen
Schlitzen 34, 35 und 36 hergestellt ist; die Schlitze 34,
35 und 36 sind senkrecht zu der Achse jedes Detektorstrei-
fens in der Gruppe 10 ausgerichtet. Der Abstand zwischen
30 jedem Schlitz in der Schlitzmaske 32 ist gleich der Länge
jedes diskreten Elementes der Detektorstreifen, wobei
die Schlitzmaske so angeordnet ist, daß die von einem Punkt
senkrecht zur Oberfläche der Schlitzmaske ausgehende Strah-
lung durch die Schlitze 34 bis 36 zu den seitlichen Mittel-
35 linien jedes benachbarten Detektorelementes in benachbar-
ten Streifen durchgelassen wird. D.h. also, daß ein sehr

- 7 -
AA.

1

schmäler "Strahlungsbalken", der den Schlitz 35 passiert, wie durch die gestrichelte Linie 38 angedeutet ist, in Querrichtung zu der Gruppe 10 an den Mittelpunkten aller diskreter Detektorelemente in der zweiten Spalte von Elementen liegen wird, wie durch die gestrichelte Linie 40 angedeutet ist.

Alle diskreten Detektorelemente in allen parallelen Detektorstreifen der Gruppe 10 haben eine identische Größe und Form; nur die Ausrichtung der Elemente in irgendeinem Detektorstreifen ist umgekehrt im Vergleich mit der Ausrichtung der Elemente in den benachbarten Streifen. Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird jedes diskrete Detektorelement, wie beispielsweise das Element 23 in der zweiten Spalte des Detektorstreifens 12, durch die Maske 21 in eine erste Hälfte mit einer über seine gesamte Länge gleichen Breite und in eine zweite Hälfte mit der gleichen Länge aufgeteilt, wobei jedoch die Breite dieser zweiten Hälfte sich exponentiell von der Mitte des Elementes bis zu seinem Ende hin sowie bis zum Beginn des nächsten, in Reihe liegenden Elementes 24 verringert. Die Elemente in den benachbarten Detektorstreifen 14 sind in umgekehrter Richtung ausgerichtet. Damit fällt also der schmale Strahlungstreifen, der den Schlitz 35 der Schlitzmaske 32 passiert hat und durch die gestrichelte Linie 40 angedeutet ist, auf die Mittelpunkte der Elemente der benachbarten, zweiten Spalte. Da die benachbarten Detektoren an ihren mittleren Bereichen die gleiche Breite haben, werden von ihren jeweiligen Leitern 26 und 27 die gleichen lichtelektrischen Ströme bzw. Photoströme abgegeben.

Wenn sich die Strahlungsquelle in der Y-Richtung verschiebt, wie durch die Pfeile 42 angedeutet ist, bleibt die durch die gestrichelte Linie 40 angedeutete Strahlung in ihrer Lage auf der Mitte der Detektorelemente der zweiten Spalte,

1 so daß die Detektorgruppe unempfindlich gegenüber einer
Verschiebung der Strahlung in der Y-Richtung ist. Eine
kleine Verschiebung des Einfallswinkels in X-Richtung ver-
5 schiebt jedoch die durch die gestrichelte Linie 40 ange-
deutete Strahlung so, daß die Photoströme von den Detektor-
elementen in einem Detektorstreifen wegen der konstanten
Detektorbreite unverändert bleiben, während der Photostrom
in benachbarten Streifen wegen der exponentiell kleiner
10 werdenden Breiten der Detektorelemente abnimmt.

Die gesamten Photoströme von allen abwechselnden Detektor-
streifen werden in ihren jeweiligen Sammelleitungen 28 und
30 addiert und auf logarithmische Schaltungen bzw. Verstär-
15 ker sowie Differenz-Schaltungen gegeben, welche die Loga-
rithmus-Werte abziehen, um ein Ausgangssignal zu erzeugen,
welches direkt proportional zu dem Einfallswinkel der Be-
leuchtungsquelle ist. Die Sammelleitungen 28 und 30 sind
also mit dem Eingang von im Handel erhältlichen Schaltungen
20 46 bzw. 48 verbunden, die eine logarithmische Kompression
durchführen, also die Stromwerte in den entsprechenden na-
türlichen Logarithmus umwandeln; die dadurch gewonnenen
logarithmischen Werte werden einem Differenzverstärker 50
und einem geeigneten Umwandler, insbesondere einem Impuls-
25 frequenzteiler (scaler) zugeführt, der ein Ausgangssig-
nal erzeugt, das direkt proportional zu dem Einfallswinkel
der Strahlungsquelle ist und diesen Winkel in geeigneten
Geraden anzeigt.

30 Fig. 2 zeigt im stark vergrößerten Maßstab eine Ansicht ei-
nes diskreten Detektorelementes, wie beispielsweise des
Detektorelementes 23 auf dem Detektorstreifen 12 in Verbin-
dung mit der Maske 21 und dem in Längsrichtung verlaufen-
den Leiter 26 für den Photostrom. Die gestrichelte Linie
35 44 stellt die schmale Strahlungsline dar, die durch den
Schlitz 35 der Schlitzmaske 32 von einer Quelle mit einem

~~-9-~~
13.

1 Einfallswinkel Null in X-Richtung verläuft; die gestrichelte Linie 40 liegt gemäß der Darstellung über der seitlichen Mittellinie des Elementes 23. Wie oben beschrieben wurde,
 5 hat die erste Hälfte des Elementes eine konstante Breite, während sich die Breite der zweiten Hälfte des Elementes 23 exponentiell verringert, um einen kleineren Photostrom zu liefern, wenn die in Querrichtung verlaufende Beleuchtungs-
 10 längs des Elementes durch eine Änderung des Einfallswinkels in X-Richtung der Strahlungsquelle verschiebt.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform soll das Verhältnis der Gesamt-Photoströme I_1/I_2 , die von den abwechselnden Detektorstreifen erzeugt werden, die folgende Beziehung erfüllen.

$$\frac{I_1}{I_2} = e^{K_1 \theta}$$

20 wobei K_1 ein Skalenfaktor und θ der Einfallswinkel sind.

Wenn die Breiten der Schlitze 34 bis 36 in der Schlitzmaske 32 sehr schmal sind, dann gilt:

25

$$e^{K_1 \theta} = f(x) = e^{(K_1 \sin^{-1} \frac{n_1}{n_e} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + H^2}})}$$

30 wobei die folgenden Bezeichnungen verwendet werden:

n_1 = Brechungsindex des Maskenmaterials,
 n_e = Brechungsindex von Luft
 35 X = eine Stelle in X-Richtung längs des Elementes,
 und

~~10~~
14

1

H = der Abstand zwischen der Gruppe 10 und
der Schlitzmaske 32.

- 5 Diese Gleichung definiert den exponentiellen Kurvenver-
lauf der Detektorelemente.

Gemäß Fig. 2 können die seitliche Mitte 52 des Elementes
23, d.h., der Punkt, an dem $X = 0$ ist, wie bei der ge-
10 strichelten Linie 40 angedeutet wird, ausgedrückt werden
durch:

$$f(X) = 1.$$

- 15 Die Kurve folgt dann der obigen Gleichung bis zu ihrem
Ende am Bezugszeichen 54, bei $X = X_{\max}$.

Die Gruppe 10, die Detektorelemente und die parallele
Schlitzmaske 12 können jede gewünschte Größe haben. Wenn
20 eine Detektorgruppe extrem klein ausgelegt wird, kann die
Länge jedes diskreten Detektorelementes, wie beispielswei-
se des Elementes 23, näherungsweise 0,60 mm und seine
Breite maximal 0,10 mm betragen. Die Breite des schmalen
Abschnittes des Elementes kann beispielsweise am Punkt 54,
25 d.h., an der Stelle, wo bei der Gleichung für die Defini-
tion der Kurve $X = X_{\max}$ ist, näherungsweise 0,02 mm und
die Breite des Leiters 26 für den Photostrom 0,01 mm sein.
Bei diesem typischen Detektor kann die gesamte Detektor-
gruppe 10 insgesamt 100 oder mehr Detektorstreifen, wie
30 beispielsweise die Streifen 12 bis 20 enthalten, während
jeder Streifen wiederum 20 oder mehr diskrete Detektor-
elemente aufweisen kann, wie beispielsweise die Elemente
22 bis 24.

- 35 Selbstverständlich werden die obigen Abmessungen eines
typischen Detektors nur als besonders zweckmäßige, nicht

1

jedoch als unbedingt erforderliche Merkmale erwähnt, da die physikalische Größe der Gruppe und die Abmessungen der Detektorelemente je nach Wunsch durch Änderung des Wertes des Skalenfaktors in der Gleichung für die Definition der Kurve variiert werden können.

10

15

20

25

30

35

16.
Leerseite

